

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

05

Журнал технической физики, т. 61, в. 1, 1991

© 1991 г.

УСКОРЕНИЕ ДИФФУЗИИ
ИОННОИМПЛАНТИРОВАННОЙ ПРИМЕСИ ПРИ БОЛЬШИХ ДОЗАХ

Ю. В. Мартыненко, П. Г. Московкин

В настоящее время ведутся интенсивные исследования ионной имплантации различных материалов. При этом во многих случаях наблюдается аномально глубокое проникновение примесных атомов в глубь образца. Предложены различные механизмы радиационно-стимулированной диффузии. В данной работе обсуждается механизм ускоренной диффузии, возможный при большой плотности тока. В этом случае достигается такая концентрация примесей, что необходимо учитывать взаимодействие между ними. Это взаимодействие приводит к «выталкиванию» примеси из имплантированного слоя в глубь образца.

Энергия взаимодействия двух примесных атомов, представляющих собой жесткие включения в материал, равна [1]

$$\Phi \cong 2\beta E_g \left(\frac{R}{r} \right)^6, \quad (1)$$

где E_g — энергия внедрения атома примеси в решетку, R — его радиус, r — расстояние между ними, $\beta = 7.5 (1 - \sigma)/(4 - 5 \sigma)$, σ — коэффициент Пуассона среды.

Это взаимодействие изменяет химический потенциал μ системы примесей. Согласно [2], добавка к химическому потенциалу равна

$$\Delta\mu = \frac{4}{3} \pi R^3 c \sqrt{2\beta E_g T}, \quad (2)$$

где c — концентрация примесей.

Градиент химического потенциала обуславливает силу, действующую на примесь $F = -(d\Delta\mu/dr)$. В результате дополнительный поток примесей, направленный в сторону убывания их концентрации, равен

$$\nabla F c = -B c \frac{\partial c}{\partial x},$$

где $v = D/T$ — подвижность примесей, температура T выражена в энергетических единицах

$$B = v \frac{4\pi R^3}{3} \sqrt{2\pi\beta E_g T}.$$

Тогда уравнение диффузии примесей принимает вид

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + B \frac{\partial}{\partial x} \left(c \frac{\partial c}{\partial x} \right), \quad (3)$$

D — коэффициент диффузии примесей.

Второй член в уравнении преобладает при $Bc \gg D$ или при

$$\frac{4\pi}{3} R^3 c \gg \left(\frac{T}{2\beta\pi E_g} \right)^{0.5}. \quad (4)$$

В этом случае уравнение (3) сводится к уравнению нелинейной диффузии

$$\frac{\partial c}{\partial t} = B \frac{\partial}{\partial x} \left(c \frac{\partial c}{\partial x} \right) \quad (5)$$

с граничным условием

$$Bc \frac{\partial c}{\partial x} \Big|_{x=0} = -j. \quad (6)$$

Это уравнение имеет автомодельное решение вида

$$c = \left(\frac{j^2 t}{B} \right)^{1/3} f \left(\frac{x}{x_\phi} \right), \quad x_\phi = (B j t^2)^{1/3}. \quad (7)$$

Полученная численно функция $f(\xi)$ хорошо аппроксимируется зависимостью

$$f(\xi) = 0.9 (1.5 - \xi). \quad (8)$$

Вблизи $x=x_\phi$ условие (4) не выполняется. Здесь следует сшить решение линейного уравнения диффузии и полученное выше решение.

Следует отметить, что при дозе $j t \cong BN_0^3/2j$ концентрация примесей вблизи поверхности становится сравнима с концентрацией атомов мишени N_0 . Но уже при этой дозе отношение глубин проникновения при нелинейной и линейной диффузиях равно

$$\alpha = \left(\frac{BN_0}{D} \right)^{1/2} = \left(\frac{1.6\pi^2 E_g}{T} \right)^{1/4}. \quad (9)$$

При $E_g/T=50$, $j=10^{16}$ см⁻²·с⁻¹, $D=10^{-12}$ см²·с⁻¹, $j t = BN_0^3/2j \cong 5 \cdot 10^{18}$ см⁻² $\alpha=6$. При дозах $j t > BN_0^3/2j$, когда концентрация примесей вблизи поверхности сравнима с концентрацией собственных атомов мишени, нельзя говорить о диффузии. В этом слое примесь либо выпадает в осадок, либо образует химическое соединение с атомами мишени. Но на больших глубинах, где $c < N_0$, можно решать диффузионную задачу с граничным условием

$$c(0) = N_0. \quad (10)$$

Уравнение (5) с граничным условием (10) имеет автомодельное решение, которое хорошо аппроксимируется функцией

$$c = N_0 \left(1 - \frac{x}{(2BN_0 t)^{1/2}} \right). \quad (11)$$

Глубина проникновения примеси превышает в этом случае глубину проникновения при обычной диффузии в $\alpha = (BN_0 e/D)^{1/2}$ раз, что для характерных параметров составляет $\alpha=6-9$.

Таким образом, при облучении интенсивными пучками, когда расстояние между примесями становится достаточно малым и надо учитывать их взаимодействие, глубина проникновения примеси в глубь имплантируемого материала значительно увеличивается.

Список литературы

- [1] Теодосиу К. Упругие модели дефектов в кристаллах. М.: Мир, 1985. 352 с.
 [2] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика. Ч. 1. М., 1976. 548 с.

Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова
 Москва

Поступило в Редакцию
 19 сентября 1989 г.
 В окончательной редакции
 3 марта 1990 г.